INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intergation No
PCT/FR2004/050433

PCT/FR2004/050433 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G03F7/00 B29C59/04 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 G03F **B29C** Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, INSPEC, WPI Data, PAJ, IBM-TDB C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category ° Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Υ RUCHHOEFT P ET AL: "Patterning curved 1-3,5,7surfaces: Template generation by ion beam proximity lithography and relief transfer by step and flash imprint lithography" JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: PART B, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 17, no. 6, November 1999 (1999-11), pages 2965-2969, XP002206574 ISSN: 0734-211X page 2965 - page 2966; figure 1 Υ US 2003/104287 A1 (YUASA MITSUHIRO) 1-3,5,75 June 2003 (2003-06-05) the whole document -/-χl Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such document "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 7 March 2005 18/03/2005 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Haenisch, U

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2004/050433

		PCT/FR2004/050433
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 199 13 683 A1 (INSTITUT FUER MIKROELEKTRONIK STUTTGART STIFTUNG DES OEFFENTLICHEN REC) 25 November 1999 (1999-11-25) the whole document	1-3,5,7
Α	US 6 416 908 B1 (JAIN KANTI ET AL) 9 July 2002 (2002-07-09)	
A	ROGERS J A ET AL: "Printing, molding, and near-field photolithographic methods for patterning organic lasers, smart pixels and simple circuits" SYNTH. MET. (SWITZERLAND), SYNTHETIC METALS, 1 NOV. 2000, ELSEVIER, SWITZERLAND, vol. 115, no. 1-3, 1 November 2000 (2000-11-01), pages 5-11, XP002279750 ISSN: 0379-6779	
A	US 6 375 870 B1 (VISOVSKY NICK J ET AL) 23 April 2002 (2002-04-23)	
Α	US 5 281 511 A (GERHARDT JOERGEN) 25 January 1994 (1994-01-25)	
Α	EP 0 845 710 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN AG) 3 June 1998 (1998-06-03)	
A .	ROOS N ET AL: "Nanoimprint lithography with a commercial 4 inch bond system for hot embossing" PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING SPIE-INT. SOC. OPT. ENG USA, vol. 4343, 2001, pages 427-435, XP002317296 ISSN: 0277-786X cited in the application	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/FR2004/050433

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 2003104287	A1	05-06-2003	JP	2003173951	A	20-06-2003
DE 19913683	A1	25-11-1999	AT WO DE EP JP US	59904533 I 1071981	A1 D1 A1 T	15-03-2003 30-09-1999 17-04-2003 31-01-2001 19-03-2002 24-09-2002
US 6416908	B1	09-07-2002	NONE			
US 6375870	B1	23-04-2002	EP JP KR	1003078 2000147229 2000035503	Α	24-05-2000 26-05-2000 26-06-2000
US 5281511	Α	25-01-1994	DE AT AU CA DE DK EP JP JP MX NO NZ	649346 2072692 2075325 59209004 526867 0526867 2109964 1992326 5200456	T B2 A A1 D1 T3 A1 T3 C A B A1 A ,B,	11-02-1993 15-11-1997 19-05-1994 11-02-1993 06-02-1993 11-12-1997 25-05-1998 10-02-1993 01-02-1998 22-11-1995 10-08-1993 15-02-1995 01-02-1993 08-02-1993 26-10-1994
EP 0845710	A	03-06-1998	EP CN	0845710 1184266		03-06-1998 10-06-1998

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No
PCT/FR2004/050433

A. CLASSEMENT	DE L'OBJET DE	LA DEMANDE	
A. CLASSEMENT CIB 7 GC	3F7/00	B29C59	/04

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 G03F B29C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, INSPEC, WPI Data, PAJ, IBM-TDB

EPO-In	ternal, INSPEC, WPI Data, PAJ, IBM-TD	В	
2 2201101			
	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		1
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	des passages pertinents	no. des revendications visées
Υ	RUCHHOEFT P ET AL: "Patterning cusurfaces: Template generation by i proximity lithography and relief to by step and flash imprint lithogra JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECH PART B, AMERICAN INSTITUTE OF PHYS YORK, US, vol. 17, no. 6, novembre 1999 (199 pages 2965-2969, XP002206574 ISSN: 0734-211X	on beam ransfer phy" NOLOGY: ICS. NEW	1-3,5,7
	page 2965 – page 2966; figure 1		•
Υ	US 2003/104287 A1 (YUASA MITSUHIRO 5 juin 2003 (2003-06-05) 1e document en entier))	1-3,5,7
	,	·	
χ Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles d	le brevets sont indiqués en annexe
"A" docume consid "E" docume ou apr "L" docume priorité autre c	ant définissant l'état général de la technique, non éré comme particulièrement pertinent ant antérieur, mais publié à la date de dépôt international ès cette date ant pouvant jeter un doute sur revendication de	inventive par rapport au docume document particulièrement pertine	ant pas à l'état de la bur comprendre le principe de l'invention ent; l'inven tion revendiquée ne peut e ou comme impliquant une activité ent considéré isolément ent; l'inven tion revendiquée impliquant une activité inventive à un ou plusieurs autres
"P" docume postér	ont publié avant la date de dépôt international, mais leurement à la date de priorité revendiquée "8	pour une personne du métier document qui fait partie de la mêr	
	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapp	
7	mars 2005	18/03/2005	
Nom et adre	sse postale de l'administration chargée de la recherche Internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Fonctionnaire autorisé Haenisch, U	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No
PCT/FR2004/050433

	R2004/050433
identification des documents cites, avec, le cas echeant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
DE 199 13 683 A1 (INSTITUT FUER MIKROELEKTRONIK STUTTGART STIFTUNG DES OEFFENTLICHEN REC) 25 novembre 1999 (1999-11-25) le document en entier	1-3,5,7
US 6 416 908 B1 (JAIN KANTI ET AL) 9 juillet 2002 (2002-07-09)	
ROGERS J A ET AL: "Printing, molding, and near-field photolithographic methods for patterning organic lasers, smart pixels and simple circuits" SYNTH. MET. (SWITZERLAND), SYNTHETIC METALS, 1 NOV. 2000, ELSEVIER, SWITZERLAND, vol. 115, no. 1-3, 1 novembre 2000 (2000-11-01), pages 5-11, XP002279750 ISSN: 0379-6779	
US 6 375 870 B1 (VISOVSKY NICK J ET AL) 23 avril 2002 (2002-04-23)	
US 5 281 511 A (GERHARDT JOERGEN) 25 janvier 1994 (1994-01-25)	
EP 0 845 710 A (SCHABLONENTECHNIK KUFSTEIN AG) 3 juin 1998 (1998-06-03)	
ROOS N ET AL: "Nanoimprint lithography with a commercial 4 inch bond system for hot embossing" PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING SPIE-INT. SOC. OPT. ENG USA, vol. 4343, 2001, pages 427-435, XP002317296 ISSN: 0277-786X cité dans la demande	
	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pertinents DE 199 13 683 A1 (INSTITUT FUER MIKROELEKTRONIK STUTTGART STIFTUNG DES OEFFENTLICHEN REC)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No PCT/FR2004/050433

Docui u rapp	ment brevet cité oort de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	1	Date de publication
US	2003104287	A1	05-06-2003	JP	2003173951	Α	20-06-2003
DE	19913683	A1	25-11-1999	AT	234477	T	15-03-2003
				WO	9949365	A1	30-09-1999
				DE	59904533	D1	17-04-2003
				EP	1071981	A1	31-01-2001
				JP	2002508583	T	19-03-2002
				US	6455429	B1	24-09-2002
US	6416908	B1	09-07-2002	AUCI	JN		
US	6375870	B1	23-04-2002	EP	1003078	A2	24-05-2000
				JР	2000147229	Α	26-05-2000
				KR	2000035503	Α	26-06-2000
US !	5281511	Α	25-01-1994	DE	4125931	A1	11-02-1993
				ΑT	160029	T	15-11-1997
				ΑU	649346	B2	19-05-1994
				AU		Α	11-02-1993
				CA		A1	06-02-1993
				DE		D1	11-12-1997
				DK		T3	25-05-1998
				EP		A1	10-02-1993
				ES		T3	01-02-1998
				JP	1992326		22-11-1995
				JP		A	10-08-1993
				JP	7012492		15-02-1995
				MX	9204476		01-02-1993
				NO	923066	А,В,	08-02-1993
				NZ 	243818 	A 	26-10-1994
EP (0845710	Α	03-06-1998	EP	0845710		03-06-1998
				CN	1184266	Α	10-06-1998